(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2003 年9 月4 日 (04.09.2003)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 03/073487 A1

(51) 国際特許分類[7]: H01L 21/28, 21/205

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/12280

(22) 国際出願日: 2002 年11 月25 日 (25.11.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2002-54542 2002 年2 月28 日 (28.02.2002) JP
特願2002-200572 2002 年7 月9 日 (09.07.2002) JP

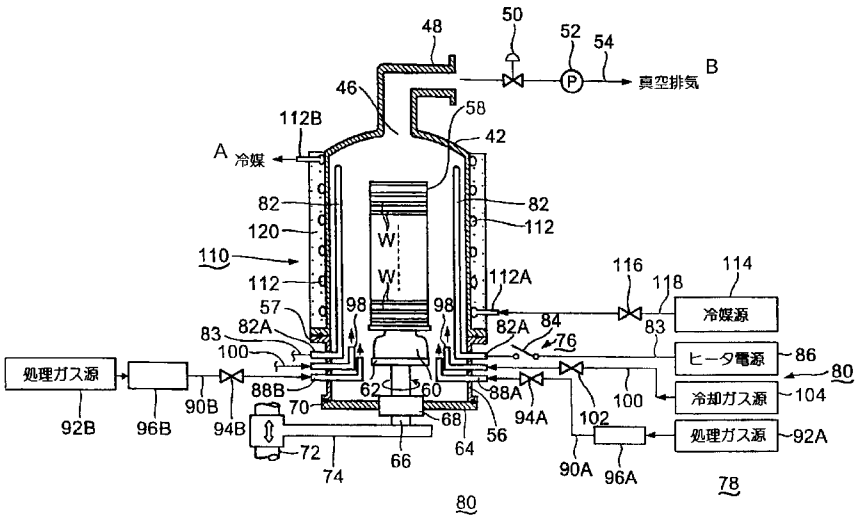
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東京エレクトロン株式会社 (TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 斉藤 孝規 (SAITO,Takanori) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 山賀 健一 (YAMAGA,Kenichi) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP). 中尾 賢 (NAKAO,Ken) [JP/JP]; 〒107-8481 東京都 港区 赤坂五丁目３番６号 東京エレクトロン株式会社内 Tokyo (JP).

[続葉有]

(54) Title: HEAT TREATMENT SYSTEM

(54) 発明の名称: 熱処理装置



A...REFRIGERANT
B...EVACUATION
92B...TREATING GAS SOURCE
114...REFRIGERANT SOURCE
86...HEATER POWER SUPPLY
104...COOLING GAS SOURCE
92A...TREATING GAS SOURCE

(57) Abstract: A heat treatment system characterized by comprising a tubular treating vessel, means for holding a plurality of articles being treated in multistage and inserting them drawably into the treating vessel, means for introducing a specified treating gas into the treating vessel, a heating means disposed in the treating vessel and heating the plurality of articles being treated held by the holding means when the holding means is inserted into the treating vessel, and means for cooling the outer wall face of the treating vessel.

(57) 要約: 本発明は、筒状の処理容器と、複数の被処理体を多段に保持すると共に、前記処理容器内に挿脱可能な被処理体保持手段と、前記処理容器内へ所定の処理ガスを導入する処理ガス導入手段と、前記処理容器の内部に設けられて、前記被処理体保持手段が前記処理容器内に挿入されている時に、前記被処理体

[続葉有]

WO 03/073487 A1

(74) 代理人: 吉武 賢次，外(YOSHITAKE,Kenji et al.); 〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内三丁目２番３号 富士ビル３２３号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, SG, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

２文字コード及び他の略語については、定期発行される各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

保持手段が保持する複数の被処理体を加熱する加熱手段と、前記処理容器の外壁面を冷却する容器冷却手段と、を備えたことを特徴とする熱処理装置である。